## РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ АУКЦИОННОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

«22» декабря 2017 г.

|  |  |
| --- | --- |
| Содержание запроса на разъяснение положений аукционной документации | Разъяснение положений аукционной документации |
| Допускается ли использование насоса другого производителя с увеличенной производительностью, например SCROLLVAC SC60D производства Leybold? | Не допускается |
| Допускается ли использование турбомолекулярного насоса другого производителя, например MAG W 1300 iP, DN 200 ISO-F X1 производства Leybold? Данный насос с магнитным подвесом и интегрированным контроллером | Не допускается |
| Допускается ли использование вакуумных датчиков другого производиделя вместо WRG-S-NW25 , например AIM-X + APG100-XLS производства Edwards? | Не допускается |
| Прошу указать размерность данной величины, а также указать значение давления с которого начинается непосредственно сам технологический процесс | Па, стандартно процесс начинается после откачки установки до 5\*10-3Па |
| Допускается ли замена титана на нержавеющую сталь 12Х18Н10Т? | Не допускается |
| Допускается ли замена затвора другого производителя? | Не допускается |
| Допускается ли замена клапанов другого производителя? Например производства SMC Япония | Не допускается |
| Допускается ли использование блоков питания магнетронов других производителей с аналогичными характеристиками? Прошу также указать количество блоков питания магнетронов. | Использование блоков питания магнетронов других производителей с аналогичными характеристиками не допускается. количество блоков питания магнетронов – 2. |
| Допускается ли блок питания нагревателя другого производителя с аналогичными характеристиками. Допускается ли использование ТЭНов из нержавеющей стали в качестве источников тепла? Допускается ли использование ИК-пирометра для контроля температуры подложек? | Не допускается |
| Допускается ли использование блоков питания ионных источников других производителей с аналогичными характеристиками? Насколько критично наличие компенсатора/нейтрализатора в ионном источнике, т.к. ионная очистка осуществляется на диэлектрик? Насколько необходима операция ионного ассистирования во время нанесения покрытий? | Не допускается использование блоков питания ионных источников других производителей с аналогичными характеристиками. Ионное ассистирование не требуется. |
| Допускается ли использование чиллера другого производителя, например производства SMC Япония? | Не допускается |
| Медная пленка толщиной до 15 мкм должна быть получена двумя магнетронами или всеми 6-ю? | Медная пленка должна быть получена двумя магнетронами, по одному на каждую сторону. |

|  |  |
| --- | --- |
| Заместитель генерального директора по развитию кооперационных связей АО «НПО НИИИП-НЗиК» | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (О.С. Макаров)  *(подпись)* |